



FIB-SEMによる3Dナノ立体構造解析

集束イオンビーム (FIB) を利用した最先端の物理解析手法を駆使し、お客様のニーズにお応えします。

FIB-SEM デュアルビーム装置 (FEI社製 Versa 3D)

- FIB
 - ・ビーム径: 5nm@30kV
 - ・イオンビーム加速電圧: 0.5~30kV
 - ・デポジション: C, Pt
- FE-SEM
 - ・電子銃: ショットキー熱電子放出型
 - ・SEM像分解能 (高真空モード) 1.2nm@30kV, 1.5nm@15kV, 2.9nm@1kV
 - ・加速電圧: 0.2~30kV
 - ・倍率: ×30 ~ ×1280k
- オプション
 - ・低真空モードSEM、3Dslicing、クライオ機能搭載

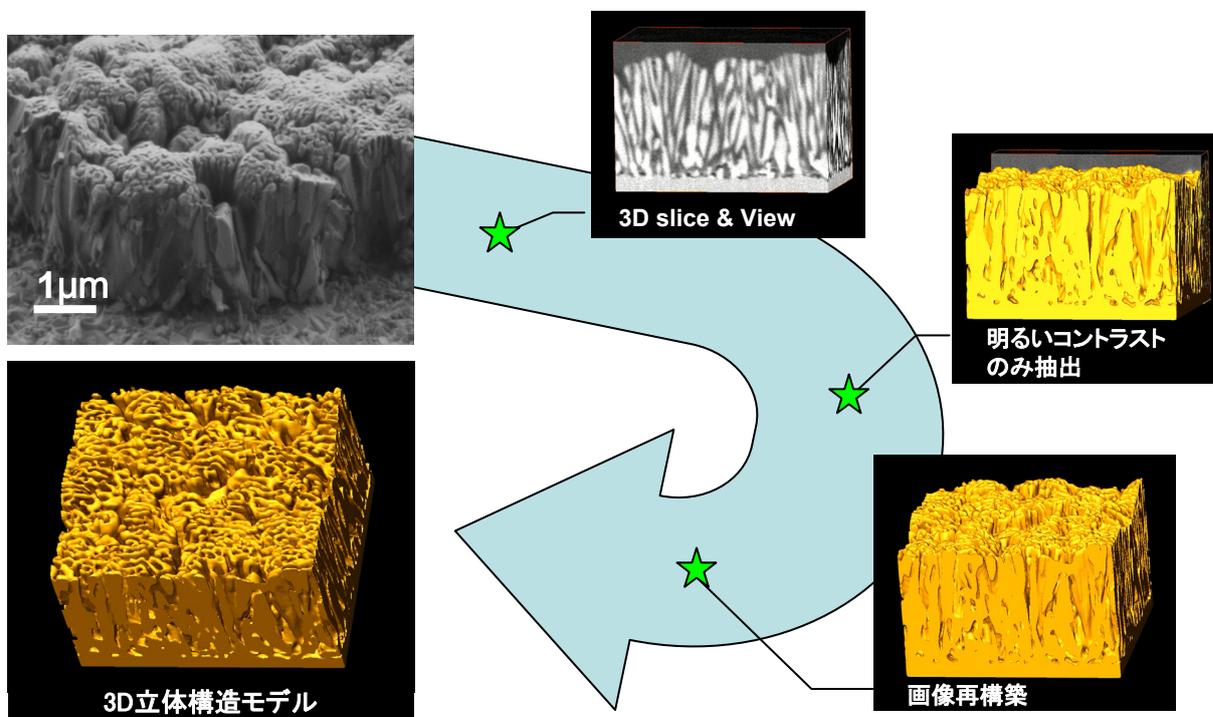


3D slice & Viewによる立体構造の解析事例

- 有機金属亜鉛 (太陽光発電デバイス) の観察

FIB加工面を連続SEM観察することで、3D立体構造の解析が可能です。

3次元立体構造モデルを再解析することで、材料の3次元分布、配合比、充填度、空孔率など材料設計に有用な情報が得られます。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<http://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2013 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。